

台灣真空學會會士遴選辦法

2016年6月30日經本學會第十五屆第八次理監事會修訂
本辦法於2010年3月30日經本學會第十二屆第五次理監事聯席會議通過

- 第一條 台灣真空學會（以下簡稱本會）為表揚本會會員在真空科技之學術或實務有重大成就，對本會有傑出貢獻者，設本遴選辦法以授予會士榮銜。
- 第二條 每年入選之會士人數以不超過一般會員及永久會員總數的百分之一為原則。若當年度無適當人選時，得從缺。
- 第三條 會士候選人必須具有本會會員身份，並經本會現任理事 3 人或現任會員 10 人以上推薦。
- 第四條 會士候選人遴選流程參照表一進行。
1. 本會秘書處每年於 1 月 15 日前，透過公開管道徵求本會會士候選人之人選推薦。會士候選人推薦表及會士候選人資料表須於每年 4 月 30 日前寄交本會秘書處，轉提交遴選委員會審查。
 2. 送審資料如下：
 - (1) 會士候選人推薦表（附件一）。
 - (2) 會士候選人資料表（附件二）。
 - (3) 兩份以上之推薦函。
 - (4) 與本會有關之學術成果、實務成就與貢獻說明。
 - (5) 著作與專利目錄：與本會有關之主要著作全文、專利資料全文等。
 - (6) 其他有利審查之個人資料。
- 第五條 遴選委員會由學術委員會推薦遴選委員 5 至 9 人，經理事會議同意後，由理事長聘任之。
- 第六條 遴選委員會完成初審作業後，初審通過名單提交本會理事會議投票表決，經過三分之二以上出席理事同意，始獲選為會士。
- 第七條 本辦法經本會理事會議通過後公佈施行，修正時亦同。

表一

【台灣真空學會會士遴選流程】

序次	工作項目	截止日期
1	發佈徵求會士候選人公告	1/15
2	送審資料收件截止日期	4/30
3	成立遴選委員會	7/01
4	遴選委員會初審作業	8/31
5	理監事會議決議作業 (三分之二以上出席理事同意)	9/30
6	公告會士遴選結果	10/31
7	公開表揚並頒發會士證書	年度會員大會